



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Проректор з навчальної роботи КПІ  
ім. Ігоря Сікорського

Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

" " 202 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

## РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2020/2021 навчальний рік

(прийому студентів 20 р.)

Спеціальність (код і назва) - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

За освітньо-професійною програмою магістерської підготовки (спеціалізацією) - Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Освітній ступінь - Магістр

Випускова кафедра - Приладів і систем неруйнівного контролю

Факультет (інститут) - Приладобудівний

Форма навчання - денна

Термін навчання - 1 рік 4 міс.  
магістра професійного з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Кваліфікація

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Назва кафедри	Обсяг дисциплін		Аудиторні години									Самостійна робота студентів	Контрольні заходи та їх розподіл за семестрами								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами													
			Кредитів ECTS	Годин	Всього	В тому числі						Екзамени	Заліки		Модульн. (темаг), конгр. роботи	Курсові проекти	Курсові роботи	РГР, РР, ГР	ДКР	Реферати	1 семестр 18 тижнів			2 семестр 18 тижнів												
						за НП з урахуван. інд. занять	Практичні (комп. практ.) за НП з урахуван. інд. занять	Лабораторні за НП з урахуван. інд. занять	Індивідуальні заняття	Всього	Лекції										Практичні	Лабораторні	Всього	Лекції	Практичні	Лабораторні										
																											за НП з урахуван. інд. занять	Практичні (комп. практ.) за НП з урахуван. інд. занять	Лабораторні за НП з урахуван. інд. занять	Індивідуальні заняття	у тому числі	у тому числі	у тому числі			
7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
<b>1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти</b>																																				
<b>1.1. Цикл загальної підготовки</b>																																				
11	Сучасна теорія управління	Приладів і систем неруйнівного контролю	4	120	54	36		18					66	1		1										3	2	1								
21	Розробка стартап-проектів	Менеджменту	3	90	54	18		36					36		1	1										3	1	2								
91	Інтелектуальна власність та патентознавство 1. Право інтелектуальної власності	Інформаційного права та права інтелектуальної власності	1	30	18	12		6					12																	1	0,7	0,3				
##	Інтелектуальна власність та патентознавство 2. Патентознавство та набуття прав	Конструювання машин	2	60	36	24		12					24		2														2	1,3	0,7					
##	Основи інженерії та технології сталого розвитку	Кібернетики хіміко-технологічних процесів	2	60	36	18		18					24		2	2													2	1	1					
##	Практичний курс іншомовного наукового спілкування 1. Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування	Кафедра англійської мови технічного спрямування №2	3	90	72			72					18		2	2				1					2		2		2		2					
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки			15	450	270	108		162					180	1	4	4				1					8	3	5		7	3	4					
<b>1.2. Цикл професійної підготовки</b>																																				
41	Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю	Приладів і систем неруйнівного контролю	6,5	195	90	36		36		18			105	1		1										5	2	2	1							
51	Курсовий проект з дисципліни Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю	Приладів і систем неруйнівного контролю	1,5	45									45		1			1																		
61	Системи оптичного неруйнівного контролю	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	36		18		18			108	1												4	2	1	1							
81	Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю	Приладів і систем неруйнівного контролю	4,5	135	36	18		18					99		1											2	1	1								
<b>Дослідницький (науковий) компонент</b>																																				
31	Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень	Приладів і систем орієнтації і навігації	2	60	27	9		18					33		1											1,5	0,5	1								
##	Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації	Приладів і систем неруйнівного контролю	2	60	18			18					42		2	2													1			1				
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки			22,5	675	243	99		108					432	2	4	2	1			2						12,5	5,5	5	2	1		1				
<b>ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ</b>			<b>37,5</b>	<b>1125</b>	<b>513</b>	<b>207</b>		<b>270</b>					<b>612</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		<b>2</b>						<b>20,5</b>	<b>8,5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>					
<b>2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти</b>																																				
<b>2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогу)</b>																																				
##	Технології CAD в інженерній графіці - 11 студ.*	Приладів і систем неруйнівного контролю	5	150	54	18		36					96		2														3	1	2					
##	Адитивні технології тривимірного прототипування	Приладів і систем неруйнівного контролю	5	150	54	18		36					96		2														3	1	2					
##	Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем	Приладів і систем неруйнівного контролю	5	150	54	18		36					96		2														3	1	2					
##	Новітні системи та технології обробки сигналів - 11 студ.*	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	36		18		18			108		2														4	2	1	1				
##	Вибрані питання статистичного аналізу кутових даних	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	36		18		18			108		2														4	2	1	1				
##	Математичні основи цифрової обробки сигналів	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	36		18		18			108		2														4	2	1	1				
##	Програмована електроніка в роботизованих системах - 11 студ.*	Приладів і систем неруйнівного контролю	5,5	165	72	36				36			93	2															4	2		2				
##	Мікроконтролери в системах неруйнівного контролю	Приладів і систем неруйнівного контролю	5,5	165	72	36				36			93	2															4	2		2				
##	Технології вбудованих систем	Приладів і систем неруйнівного контролю	5,5	165	72	36				36			93	2															4	2		2				
##	Інформаційні та інтелектуальні системи - 11 студ.*	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	18		54					108		2														4	1	3					
##	Інтелектуальний аналіз даних	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	18		54					108		2														4	1	3					



##	Алгоритми глибинного навчання	Приладів і систем неруйнівного контролю	6	180	72	18		54				108		2								4	1	3							
	<b>Разом вибіркового ОК циклу професійної підготовки</b>		<b>22,5</b>	<b>675</b>	<b>270</b>	<b>108</b>		<b>108</b>				<b>405</b>		<b>1</b>	<b>3</b>							<b>15</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>						
	<b>ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ</b>		<b>22,5</b>	<b>675</b>	<b>270</b>	<b>108</b>		<b>108</b>				<b>405</b>		<b>1</b>	<b>3</b>							<b>15</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>						
	<b>ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:</b>		<b>60</b>	<b>1800</b>	<b>783</b>	<b>315</b>		378		90		1017		4	11	6	1		2		1	20,5	8,5	10	2	23	9	11	3		
		<b>Кількість</b>																													
		<b>Екзаменів</b>																													
		<b>Заліків</b>																													
		<b>Модульн. (темат), контр.робіт</b>																													
		<b>Курсових проєктів</b>																													
		<b>Курсових робіт</b>																													
		<b>РГР, РР, ГР</b>																													
		<b>ДКР</b>																													
		<b>Рефератів</b>																													

СКОРОЧЕННЯ:

РГР - розрахунково-графічна робота;

РР - розрахункова робота;

ГР - графічна робота;

ДКР - домашня контрольна робота (виконується під час СРС)

d - кількість членів ДЕК з даної кафедри

Ухвалено на засіданні Вченої ради інституту ПРОТОКОЛ № від р.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_ / д.п.н. Протасов А.Г. /  
(підпис) (П.І.Б.)

Декан факультету \_\_\_\_\_ / д.т.н.Тимчик Г.С. /  
(директор інституту) (підпис) (П.І.Б.)

Примітка: РНП складається на кожний навчальний рік окремо відповідно до навчального плану  
\* Кількість студентів, які вибрали дисципліну

"3" червня 2020 р.